化合物半導体 ZnSe への In 拡散-1

竹野下 寛

長崎大学教育学部技術教育講座 (平成11年3月15日受理)

In Diffusion in Compound Semiconductor of ZnSe-1

Hiroshi TAKENOSHITA

Department of Technology, Faculty of Education, Nagasaki University, Nagasaki 852-8521 (Received March 15, 1999)

Abstract

II - VI属化合物半導体 ZnSe(Eg=2.68 eV)の結晶評価の一環として In 不純物の熱拡散を行い、カソードルミネスセンセンス (CL)法を使って不純物準位測定を試みた。

In 拡散源には InCl₃(3N) と In(6N) の2種を用い, ZnSe 単結晶基板(6N), ドー パント In を石英アンプルに真空封入して熱拡散を行った。また,比較用に Zn(6N) 雰 囲気で熱処理した試料も準備した。電子線源には走査型電子顕微鏡を用い,電子線の加速 電圧=25 kV,吸収電流=1~6×10⁻⁹ A, 試料への照射電子線経は約1µ㎡である。拡散 済み ZnSe 基板は劈開し,劈開断面に電子線を照射して In 拡散が行われた場所(記号 S) と中心部の未拡散場所(記号 C) について2.5 nm ステップで400~800 nm の波長範囲を 室温で測定した。

ドーパントに InCl₃を用いた場合, CL 発光強度は弱く, 拡散層は厚く, 不純物の拡散 速度が速い(600℃, 4 ~ 8 × 10⁻⁸ cm/sec)。CL 発光は, ①: 462.5 nm(バンド間遷移), ②: 547.5 nm(Cu ドナーー充満帯間遷移, (Cu-Green), ③: 615.0 nm(伝導帯-Cu アクセ プタ間遷移, (Cu-Red), ④: ~680 nm(V_{Zn} (0.1 eV)-I_{Se}(0.65 eV) または Cl(0.19~ 0.21 eV)-Cu(0.65 eV) 間遷移)が観察された。これは, 使用したドーパントInCl₃(3 N)の純度が不足し, 残留不純物としての Cu の効果が大きいことが分かった。

ドーパントIn(6N)場合は、CL 発光強度は全体に強く、拡散層は薄い。拡散速度は 600℃で3~4×10⁻¹⁰cm/sec である。CL スペクトルから、前者と同様に①、②、③、 ④が観察された。純度6N でも基板の残留不純物や拡散用容器などからの Cu 汚染があ ることを示している。 測定波長範囲が400~800 nm, 室温(約25 meV)測定とういう制約もあり,測定全体 の CL スペクトルから明確な In 不純物準位を介した発光は見つからなかった。しかし, (a) Zn 熱処理試料と試料中心部の未拡散場所(C)と,(b) In(6 N) 拡散(S)の①発光 部分のスペクトル分布を比較してみると,中心波長は同じであるが,(a)の場合のスペク トル分布は短波長側に,(b)の場合は長波長側に広がっている。スペクトルの半値幅か ら求めた中心波長は(a)では461.4 nm(2.686 eV)はバンド間遷移,(b)は464.4 nm (2.669 eV)で,両者の差は17 meVである。室温(約25 meV)測定であることを考慮す れば,後者は In ドナー(28 meV)¹⁻²と充満帯間遷移の発光であることが分かった。

1.はじめに

Ⅱ-M属化合物半導体 ZnSe は禁制帯幅=2.68 eV のワイドギャップ半導体材料の一つ で,青色から赤色までの可視光領域の発光が得られることで知られている。しかし,高純 度で大型の単結晶が得にくいこと,補償効果により高電導度が得にくい,伝導形の制御が 困難なことなどのため有用性を秘めながら未だに実用化されていない物質である。

ZnSe に In をドープすると,浅いドナー準位 (D:28 meV)^{1,2)}を作ると報告されて いる。浅い準位を持つ不純物をドープすることで,高電導度の ZnSe 試料が得られると期 待出来る。そこで,ZnSe 単結晶基板に In を熱拡散させた試料を製作し,カソードルミ ネスセンセンス (CL) 法を使って In 不純物準位の評価を試みた。

試料 ZnSe は純度(99.9999%-6N)の Zn と Se 元素を用いて加熱合成した後, Piper-Polish 法³⁾により単結晶を成長させた。育成した ZnSe 単結晶塊から(110)面 劈開して薄板(~3×5×0.5mm³)を取り出し試料基板に用いた。In 拡散源には InCl₃ (99.95%-3N)と In(99.9999%-6N)の2種を用いて熱拡散を行った。

また,比較用に Zn(99.9999%-6N) 雰囲気で熱処理した試料も準備し測定た。Zn 雰 囲気処理を実施することで,抽出効果により ZnSe 基板純度の向上を図っている。

ドーパントにInCl₃ (3N)を用いた場合,拡散層は厚く,拡散速度は非常に速い(600 ℃で、4~8×10⁻⁸ cm/sec)。しかし、CL 発光強度は全体に弱い。ブロードな発光ピー クは、弱い①青色:462.5 nm、②:緑色(Cu-Green)547.5 nm(2.26 eV)[Cuドナー (0.4 eV)-充満帯間遷移]と③:赤色(Cu-Red)615.0 nm(2.02 eV)[伝導帯-Cuア クセプタ(0.65 eV)間遷移]、④:~680nm[Zn 空孔(V_{Zn}, 0.1 eV)-格子間 Se(I_{Se}, 0.65 eV)間遷移]または Cl(0.19-0.21 eV)-Cu(0.65 eV)間遷移)が観察された。検 出された Cu はドーパント InCl₃(3N)の純度が低く、ドーパント InCl₃に含まれる不 純物によることが分かった。

ドーパントに In(6N)を用いた場合,拡散層は薄く,拡散速度(600℃, 3~4× 10⁻¹⁰cm/sec)と遅い。しかし,CL発光強度は強い。CLスペクトルは①,②,③,④の ピーク波長が観察され,ドーパント InCl₃(3N)の場合に同じである。ドーパントの違 い,In 拡散条件の違いにより発光ピーク波長位置は変化しないで,その発光強度の相互 関係が変化している。本実験は室温での測定であることも関係して,In 不純物による発 光ピーク波長の移動の効果は顕著に見いだされなかった。

①:青色発光ピーク波長値462.5 nm は全ての試料で同じ波長である。しかし,430~

500 nm の波長間を拡大してグラフを描く(第5図参照)と,未拡散部分(C)と Zn 雰 囲気処理試料からの CL スペクトル分布は短波長側に広がり, In 拡散部分(S)からの CL スペクトル分布は長波長側に広がっていることが分った。

そこで,第5図の CL プロファイルの半値幅からピーク波長を求めると,未拡散部分では461.4 nm(2.686 eV),拡散部分では464.5 nm(2.669 eV)が得られる。前者461.4 nm(2.686 eV)がバンド間遷移であるとすると,後者(2.669 eV)は In ドナーと充満帯間の遷移と考られ,両者のエネルギ差は17 meV である。室温測定であるから,室温が約25 meV であることの広がりを考慮すれば,拡散部分からの測定値(記号 S)は In ドナー 準位28 meV を介した CL 発光と考えられる。

ここで使用している Zn,Se,In などの元素は純度 6 N, InCl₃は 3 N である。これは現在 市販されている材料としては最高純度の商品である。ZnSe 単結晶基板のスタート元素の 純度は 6 N で, ノンドープ試料の場合でも CL 測定から Cu 不純物による CL スペクト ルが観察されていた。 $^{4-6}$ InCl₃(3 N) をドーパントに用いた場合では In 拡散の効果 よりも, 残留不純物 Cu の効果が大きかった。ドーパントに In(6 N) を用いた場合は In の効果と Cu の効果が観察された。これらのことは純度 6 N 程度では半導体の純度とし ては十分なものでないことを示している。

2. 実験方法

2-1. ドーパント In

In 拡散源には $InCl_3(3N)$ と In(6N) の2種で行った。

(a) In 金属のクリーニングは容易ではない。そこで、簡単に取り扱えるということから、InCl₃ (99.95% – 3 N)を用いた。まず、InCl₃ のアセトン10%溶液を準備する。 ZnSe 基板をこの溶液に浸した後、ひきあげて乾燥させた後に石英アンプルに真空封入した。

 $InCl_3$ は最高純度 3N のものしか市販されていない。CL 測定結果に見られるように, In の効果よりも Cu の効果が大きく, $InCl_3$ の純度不足と考えられ拡散源として適切な 選択ではなかった。

(b)In(6N) はエッチングの後, In:~300mgと ZnSe 基板 (~50mg) とを石英アン プルに真空封入した。エッチングは ZnCl₂ のグリセリン溶液 (~150℃) で行っている。

2-2. In拡散 ZnSe 試料

Ⅱ- Π 族化合物半導体 ZnSe は,純度 6 N の Zn と Se の元素金属を化学等量比に混合 して加熱合成する。加熱合成した ZnSe 粉末を, Piper-Polish 法²)により単結晶を成長 させた。製作した単結晶塊から(110)劈開して約 3 × 5 × 0.5mm³の単結晶板を取りだ して使用した。ZnSe 基板のエッチングには NaOH(50℃) 水溶液で行い,エッチング後 は十分に純水で洗浄する。

ZnSe 基板,ドーパント材料は洗浄し計量した後,直ちに石英管にチャージして排気を 開始し,真空度 = 4 × 10⁻⁵ Torr で真空封入した。真空封入した石英アンプルは600℃に 安定化した電気炉にセットして,拡散温度を600℃で固定し拡散時間を変数にして熱拡散 を行った(第1表参照)。

石英管は1:2に純水で薄めた王水に約半年浸す方法を採った。CL 測定結果から,容器の石英管から Cu 不純物が供給された形跡があった。石英管の品質にも依存するが半年間のクリーニングでは不足であることを示唆している。

熱処理条件は、第1表に示すような範囲で行い、所定時間経過後に炉から取り出し急冷 する。アンプルから取り出した拡散済み ZnSe ウエハーは基板平面に垂直に劈開して、電 子線を劈開断面に照射出来るように上に向けて試料ホルダに導電性ペーストで貼りつけ た。

2-3. CL 測定

電子線源には走査型電子顕微鏡(SEM)の機能を使い,電子線の加速電圧=25 kV,吸 収電流=1~6×10⁻⁹ Aの条件で実施した。観察用試料を SEM にセットして, SEM 機能を使って劈開断面の CL 測定場所を選択する。次に選択場所の1点(直径1 μ m)に 電子線を照射(走査停止)して CL スペクトルを測定した。

In 拡散が行われた場所 (基板表面側, データ記号 S), と未拡散場所 (基板中心部, デー タ記号 C) について異なる場所の数ヵ所を任意に選択して, それぞれの場所毎に CL ス ペクトルを測定した。CL スペクトルは2.5 nm ステップで400~800 nm の波長範囲を室 温 (295 K) で測定した

直径約1µmの CL 発光点からの光は分光器で分光し、ホトマルチプライヤで電気信号 に変換した後、ロックインアンプで増幅し、GPIB インターフェースを介してパソコンに

Dopeant	Heat Tr Temperature (C)	eatment Time(h)	Lot No.
InCl ₃ (3N)	600	20	DCI-04
	600	40	DCI-01
	600	70	DCI-02
	600	100	DCI-03
	600	160	DCI-05
In(6N)	600	6	DCI-19
	600	20	DCI-12
	600	45	DCI-13
	600	60	DCI-15
	600	91	DCI-14
	600	123	DCI-13
	600	240	DCI-11
	600	430	DCI-18
Zn(6N)	600	71	DCI-20

第1表 熱処理条件

14

取り込んだ。

分光器は回折格子型(ブレーズ波長:500 nm)を使用し分解能は0.25 nm である。ホ トマルチプライヤは S-20光電面を用いた。

測定する光波長と共に,回折格子型モノクロメータとホトマルチプライヤの光感度が変 化するために,検出・増幅した CL 発光強度は感度補正を施し正規化して作図する。補 正値は光波長400~850 nm の範囲で用意している。500 nm では補正係数は約1 であるが 600 nm 以上の長波長範囲になると分光系の感度低下から補正値が急増し,700 nm では 補正係数は約100となっている。このため,長波長側ではグラフ曲線が変動しているが, 測定値の変動が補正値倍されてグラフ化されるためである。

これら測定装置,測定条件は既報に同じである。4-6)

2-4. 熱処理条件

第1表に示すように拡散温度を600℃に固定し,拡散時間を変化させた。600℃より高温 では石英アンプルなどの容器からの汚染が考えられ,他方,低温では拡散速度が遅くなる ためである。

比較のため、Zn(6N)で熱処理し、抽出効果により純化した ZnSe 基板も用意した。

3. 実験結果

第1表に示した拡散条件を施した ZnSe 基板は,各試料ごとに数箇所ずつ拡散層(記号S)と未拡散層である中心部(記号C)とを測定している。試料に電子線を照射すると,拡散層(S)は赤色発光し,未拡散部分(C)は緑色に発光しているので拡散層は容易に検出・区別できる。



第1図 CL スペクトル-1

熱処理条件:ドーパント: InCl₃ (3N), 600°, 70 h S:拡散層(表面)のCL測定, C:未拡散部(中心部)のCL測定 ①:462.5 nm(バンド間遷移), ②:547.5 nm(Cu(0.4 eV)ドナー(D)-充満帯間遷移 (Cu-Green), ③:615.0 nm(伝導帯-Cu(0.65eV)アクセプタ(A)間遷移(Cu-Red)), ④:~ 680 nm(V_{Zn}-I_{Se} または In-I_{Se} 間遷移) ドーパントに InCl₃(3N)を用いた場合,全体に CL 発光強度は小さく,拡散層は大変に厚い。代表的な CL スペクトルグラフを第1図に示す。発光ピークは①:462.5 nm(バンド間遷移),②:547.5 nm(Cu(0.4 eV)ドナー(D)-充満帯間遷移,(Cu-Green),③:615.0 nm(伝導帯-Cu(0.65 eV) アクセプタ(A)間遷移,(Cu-Red)),④~680 nm[Zn 空孔(V_{Zn}, 0.1 eV)-格子間 Se(I_{Se}, 0.65 eV)間遷移]または Cl(0.19-0.21 eV)-Cu(0.65 eV)間遷移)が観察される。④はブロードな発光であり,いずれの遷移であるか定めにくい。また,拡散層厚さから計算した拡散速度は600℃で,4~8×10⁻⁸ cm/sec である。このような早い拡散速度を持つ不純物は Cu 以外にはない。以上の結果,InCl₃(3N)ドーパントでは Cu の拡散効果が検出された。検出された Cu 不純物準位は,ドーパントの純度不足による残留不純物 Cu に起因する。

ドーパントに In(6N) を用いた場合,発光強度は全体に強く,拡散層は薄い。拡散速度は600℃, $3 \sim 4 \times 10^{-10}$ cm/secであって In 拡散によると考えられる。代表的な熱処理時間45 h と240 h の場合の CL スペクトルグラフをそれぞれ第2, 3 図に示した。いずれの場合も発光ピークは①:462.5 nm(バンド間遷移), ②:547.5 nm(Cu-Green), ③:615.0 nm(Cu-Red), ④:~680 nm[Zn 空孔 (V_{Zn}, 0.1 eV)-格子間 Se(I_{Se}, 0.65 eV) 間遷移] または Cl(0.19-0.21 eV)-Cu(0.65 eV) 間遷移] が観察される。

このように、In(6N) ドーパントの場合も全熱処理条件の試料を通じて In が関与した と考えられる明確な発光は見いだせなかった。

そこで、In ドープの効果を見るため、各熱処理条件から、代表的な1つの CL スペクトル測定値を選択し、Zn 雰囲気で熱処理(71 h)したスペクトルを追加して描いたグラフが第4図である。このグラフからも、発光ピークは①:462.5 nm(バンド間遷移)、②:547.5 nm(Cu-Green)、③:615.0 nm(Cu-Red)、④:~680 nm が観察される。熱処



熱処理条件:ドーパント:In(6N), 600℃, 45 h

S:拡散層の CL 測定データ, C:未拡散部の CL 測定データ

①:462.5 nm(バンド間遷移),②:547.5 nm(Cu(0.4 eV) ドナー (D)-充満帯間遷移 (Cu-Green),③:615.0 nm(伝導帯-Cu(0.65eV) アクセプタ(A) 間遷移(Cu-Red)),④:~ 680 nm(V_{Zn}-I_{Se} またはIn-I_{Se} 間遷移)



熱処理条件:ドーパント:In(6N), 600℃, 240 h S:拡散層の CL 測定データ, C:未拡散部の CL 測定データ ①, ②, ③, ④は第2図に同じ。



各種熱処理条件 CL スペクトルの比較

S:熱処理条件:ドーパント:In(6N), 600℃, 熱処理時間:6, 20, 45, 91, 123, 240 hからの代 表的な CL スペクトル

C:熱処理条件:Zn(6N) 熱処理(71h),及び,未拡散場所からの代表的な CL スペクトル①,②,③,④は第2図に同じ。

理条件の違いによって4つの発光ピーク位置は同じで相互の強度の違いが生じている。

特に Zn 熱処理試料の CL スペクトルのピーク値は、バンド間遷移①が非常に強く、Cu 不純物による②、③、④の発光は共に小さい。これは、抽出効果により基板内の native impurity が抽出されて ZnSe 基板の純度が向上していることを示している。他方、未拡 散部分 (C) からの CL スペクトルでは②、③、④が観察されている。①のピーク値は小 さいものの、Zn 雰囲気処理の場合と全く同じ波長位置にある。このように、Zn 処理、 未拡散層 (C) 共に、①のピーク波長は462.5 nm で同一である。

そこで、第4図の拡散部分(S)、及び Zn 熱処理と未拡散部分(C)のスペクトル測定値 を使って、波長430~500 nm の範囲だけを拡大して描いたグラフが第5図である。25 nm 間隔での測定のため、グラフはなめらかでは無く、第2~4図と同様に測定値のピーク波 長は462.5 nm と同一である。しかし、Zn 熱処理と未拡散部分(C)のスペクトル分布は 短波長側に広がっており、In 拡散層からのスペクトル分布は長波長側に広がった2グルー プに分けられる。このスペクトル分布の半値幅から求めたピーク波長は、未拡散部分 (C)では261.4 nm(2.686 eV)、拡散部分(S)では464.5 nm(2.669 eV)が得られる。

未拡散部分(C)の発光波長261.4 nm(2.686 eV)はバンド間遷移,拡散部分(S)の発 光波長464.5 nm(2.669 eV)はInドナーと充満帯間の遷移と考えると、両者のエネルギ差 は17 meV なる。室温測定であるから、室温が約25 meV に相当することを考慮すれば、 In拡散部分(S)からの CL スペクトルは長波長側へシフトしており、464.5 nm(2.669 eV)の発光は In ドナー準位28 meV と充満帯間の遷移によるものである。



第5図 CL スペクトルー5

Zn 熱処理及び未拡散場所(C) と In 拡散部分(S) の CL スペクトルの比較 波長範囲430~500 nm の拡大図。Zn 熱処理及び未拡散部分(C) のスペクトル分布は短波長側に, In 拡散部(S) からのスペクトル分布は長波長側にシフトしている。

全熱処理条件の各試料の拡散深さを第6図 に示した。ドーパントにInCl₃を用いた場合 と, In(6N)を用いた場合との拡散速度を 比較すると, InCl₃では拡散速度 4 ~ 8 × 10^{-8} cm/sec に達し長時間熱処理試料では 全体に Cu 拡散し未拡散部分が見いだせなか った。この拡散速度は Cu(第6図点線)に よるものであり, InCl₃(3N) はドーパント として不適切である。

In(6N)ドーパントの場合では,6hと 20hの短時間の拡散条件の場合には,拡散速 度=3~4×10⁻¹⁰cm/sec(600℃)(第6図 直線)と算出される。しかし,熱処理時間が 長くなるほど指数関数的に拡散速度は上昇し 熱処理時間100h以上では拡散速度=2~3 ×10⁻⁹ cm/sec(600℃)になっている。

これは, 熱処理時間の比較的短い2点(6, 20 h)の速度がInの持つ本来の拡散速度と考 えられる。長時間熱処理すると, 拡散速度の 速い Cu がより内部にまで拡散するために



Cu の拡散速度に慚近していく課程にあると考えられる。Cu 供給源は拡散用容器-石英 管-からの汚染と推定している。

4.検討

第1~4図における①発光は波長462.5 nm で観察されるピーク値のエネルギーは2.68 eV である。これは、ZnSe のバンド間遷移に相当する。Zn 熱処理試料で最も顕著に検出 され、未拡散場所(C)のピーク位置と同じである。第5図に示した拡大スペクトルの半 値幅からから求めたピーク波長は261.4 nm(2.686 eV)で、ZnSe のバンド間遷移による 発光である。他方、In 拡散層から検出される発光は①に非常に接近しており、その半値 幅から求めたピーク値は464.5 nm(2.669 eV)である。両者のエネルギ差は17 meV であ る。In ドナー準位は28 meV^{1, 2)}と報告されている。引用した文献^{1, 2)}には測定温度が 明記されていないが77 K での値と推定される。本実験は室温であり、室温のエネルギー は約25 meV であることを考慮すると、我々が室温測定(279 K)で得た17 meV の差は In 不純物準位(28 meV:D) – 充満帯間の遷移による発光と考えて差し支えない。CL 測定を 室温から液体窒素(77 K)温度に冷却して測定すれば、この点は明快になるであろう。

基板 ZnSe を Zn で熱処理した後に Cu 拡散を行うと Cu の拡散速度は約1/100に低下 することが報告されている。^{1,6)}本実験において,容器からの微量の Cu が ZnSe 基板 内に拡散するには, (a)In 拡散層を通過しなければならない (Cu の拡散速度が本来の早 さの1/100までに低下), (b) 容器からの Cu 供給量が少なく, 多量にあるドーパント In に希釈される。拡散速度が熱処理時間とともに上昇するのは,原因(a)で Cu の拡散速 度が小さくなっているが,熱処理時間とともに,拡散速度の速い Cu が支配的になるもの の,容器からの Cu 供給量が少ない-原因(b)-のために本来の Cu 拡散速度よりも小さ く観察されることになる。更なる長時間熱処理を実施すれば InCl₃の場合の曲線(第6図 点線)に慚近するものと考えられる。

④:~680 nm の幅広い発光は (V_{Zn} , 0.1 eV) – 格子間 Se(I_{Se} , 0.65 eV) 間遷移]またはCl(0.19-0.21 eV) – Cu(0.65 eV) 間遷移が該当する。しかし, グラフでは最大のプロードなピークを形成しているものの, 光検出系の感度低下による補正の結果である。測定値そのものは①, ②の値が大きい。

基板中に存在すると予測される V_{Zn} (D:0.1 eV), I_{Se} (A:0.65 eV) の存在も明確ではな い。In ドープに当たって, InCl₃ 化合物を用いた場合の CL スペクトルからは, CuCl₂ ドーパントを用いた前報⁷⁾ と同じく, Cl 元素 (D:0.19-0.21 eV) の関与した準位につ いての知見は明確ではない。

波長700 nm 以上の長波長側では, CL 測定の値そのものはほとんど変化しないが,モ ノクロメータ,ホトマルチプライヤの感度低下に伴う補正係数が急増する。そのため,正 規化することで値が補正係数倍されて変動が大きくなる。それ故,ピーク値の信頼性は低い。

Cu 不純物による D-A ペア発光では1.62 eV(波長765 nm) である。この波長は測定 範囲ではあるが,波長700 nm 以上の測定値自体は小さく不安定で,光学系の感度補正に より大きく変動しており信頼性は低いためにピークの存在は考えにくい。これら長波長発 光についての解析は,低温での測定結果を待って報告することにする。

5.結論

カソードルミネスセンセンス(CL)法を使って、 $\Pi - M$ 属化合物半導体 ZnSe の In 不純物準位の評価を行った。電子線の加速電圧=25 kV,吸収電流= $1 \sim 6 \times 10^{-9}$ A,試料に照射している電子線面積は約 1 μ m²である。拡散済み ZnSe ウエハーは劈開し、その断面に電子線を照射して In 拡散が行われた場所と中心部の未拡散場所について数箇所ずつ測定した。CL スペクトルは25 nm ステップで400~800 nm の波長範囲を室温で測定した。

CL スペクトルから,いずれの拡散条件の試料からも①:462.5 nm(バンド間遷移), ②:547.5 nm(Cu(0.4 eV)ドナー (D)-充満帯間遷移,(Cu-Green),③:615.0 nm(伝 導帯-Cu(0.65) アクセプタ(A) 間遷移,(Cu-Red)),④:~680nm[Zn 空孔(V_{Zn}, 0.1eV)-格子間 Se(I_{Se}, 0.65 eV)間遷移]または Cl(D:0.19-0.21 eV)-Cu(A:0.65 eV) 間遷移]が観察された。

特にドーパントに InCl₃ を用いた場合は、全試料で CL 発光強度が弱く、拡散速度が 速い(600℃、4~8×10⁻⁸ cm/sec)。ドーパントInCl₃(3N)は純度が低く、残留不 純物として Cu が含まれていることが分かり、ドーパントとして不適切である。

ドーパント In(6N) を使用した場合, CL 発光強度は強く拡散速度は遅い(600℃, 3 $\sim 4 \times 10^{-10}$ cm/sec)。いずれの拡散条件の試料からも②: Cu-Green,③: Cu-Red が 観察され,純度 6N の材料でも残留不純物が存在し,拡散用容器などからの汚染がある ことが分かった。 しかし, (a) Zn 熱処理と試料中心部の未拡散場所 (C) と, (b) In(6N) 拡散層 (S) の青色発光①のスペクトル分布を比較してみると, (a), (b) 両者ともピーク波長は642. 5 nm であるが, (a) の場合はスペクトル分布は短波長側に広がり, スペクトルの半値幅 から求めた中心波長は (a) では641.4 nm(2.686 eV) がえられ, これはバンド間遷移で ある。(b) の場合は長波長側に広がり, 同様に半値幅から求めたピーク波長は644.4 nm (2.669 eV) でる。両者の差は17 meV である。室温測定 (約25 meV) であることを考慮 すれば, (b) は In ドナー準位 (28 meV) と充満帯間遷移の発光である。

《引用文献》

- 1) M. Aven and J. S. Prener: *Physic and Chemistry of II VI Compounds (North-Holland, Amsterdam, 1967)*
- 2) 塩谷繁雄,豊沢豊,国府田隆夫,柊元宏:光物性ハンドブック(朝倉出版,東京,1984)
- 3) W. W. Piper and S. J. Polish: J. Appl. Phys. 32 (1961) 1278.
- 4) H. Takenoshita, T. Nakau and I. Nakao: Jpn. J. Appl. Phys 19. (1980) suppl. 19-1. p. 33.
- 5) H. Takenoshita, K. Kido and K. Sawai: Jpn. J. Appl. Phys. 25 (1986) 1610.
- 6) H. Takenoshita: Solar Cells 16 (1986) 65.
- 7) 竹野下寬·滝川健:長崎大学教育学部紀要-自然科学-No. 60(1999.3) 18.